МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи _____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО "___"_____ 2024 р.	Спеціальність Освітня програма Освітній ступінь Випускова кафедра	161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія магістра *Кафедра хімічної технології кераміки та скла*	Факультет/ННІ Форма здобуття вищої освіти Строк навчання Кваліфікація	Хіміко-технологічний факультет *Очна (денна)* 1 рік 9 місяців магістр з хімічних технологій та інженерії

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув. Бюджет	К-ть здобув. Контракт	Обсяг дисциплін Кред ECTS	Обсяг дисциплін Години	Аудиторні години Всього	Лекції за НП	Лекції з урах. Інд занять	Практ. (комп. прк) за НП	Практ. (комп. прк) з урах. Інд занять	Лабор за НП	Лабор з урах. Інд занять	Інд. зан.	СРС	Контрольні заходи Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами: 2 курс, ХМ-31мн (Б: 1, К: 0); 3 семестр (18 тижнів) Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб	4 семестр (0 тижнів) Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2*	АМТС1	1	0	1.5	45	36	-	-	36	-	-	-	0	9		3	3						2		2					
2	*Педагогічна майстерність*	ПП	1	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		3	3						2	1	1					
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					3.5	105	72	18	0	54	0	0	0	0	33	0	2	2	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0
Цикл професійної підготовки																															
3	*Хімічні технології нульового забруднення. Курсова робота*	ТНРВ та ЗХТ	1	0	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30		3		3												
4	*Хімічні технології нульового забруднення*	ТНРВ та ЗХТ	1	0	5.5	165	72	18	-	18	-	36	-	0	93	3		3						4	1	1	2				
5	*Моніторинг навколишнього повітряного середовища найновішими сенсорними системами*	ТЕХВ	1	0	6.0	180	90	18	-	18	-	54	-	0	90	3		3				3		5	1	1	3				
Дослідницький (науковий) компонент																															
6	*Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації*	ХТКС	1	0	6.0	180	90	-	-	18	-	72	-	0	90		3	3						5		1	4				
7	*Науково-дослідна практика* †	ХТКС	1	0	9.0	270	0	-	-	-	-	-	-	0	270		4														
8	*Виконання магістерської дисертації*	ХТКС	1	0	17.0	510	0	-	-	-	-	-	-	0	510																
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					44.5	1335	252	36	0	54	0	162	0	0	1083	2	3	3	1	0	0	1	0	14	2	3	9	0	0	0	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					48	1440	324	54	0	108	0	162	0	0	1116	2	5	5	1	0	0	1	0	18	3	6	9	0	0	0	0
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
9	*Сучасні проблеми силікатного матеріалознавства*	ХТКС	1	0	8.0	240	90	36	-	18	-	36	-	0	150	3		3				3		5	2	1	2				
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					8	240	90	36	0	18	0	36	0	0	150	1	0	1	0	0	0	1	0	5	2	1	2	0	0	0	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					8	240	90	36	0	18	0	36	0	0	150	1	0	1	0	0	0	1	0	5	2	1	2	0	0	0	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					56	1680	414	90	0	126	0	198	0	0	1266	3	5	6	1	0	0	2	0	23	5	7	11	0	0	0	0

† Опанування освітнього компонента здійснюється на підприємстві

Кількість																															
Кількість екзаменів	3																							3							
Кількість заліків	5																								4				1		
МКР	6																									6					
Курсових робіт	1																										1				
Курсових проєктів	0																														
РГР, РР, ГР	0																														
ДКР	2																									2					
Рефератів	0																														

ПРАКТИКА

Назва практики	Термін проведення	Тижні	Семестр
Науково-дослідна практика	2025-02-03 - 2025-03-09	5	4

АТЕСТАЦІЯ

Форма випускної атестації	Термін проведення
Захист кваліфікаційної роботи	2025-05-19 - 2025-05-31

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Вид роботи	Норма в годинах на 1 здобувача	Кафедра	Кількість здобувачів Б	Кількість здобувачів К	Всього годин Б	Всього годин К
Керівництво	33	ХТКС	1	0	33	0
Консультування	1	ХТКС	1	0	1	0
Рецензування	4	ХТКМ	1	0	4	0
ЕК	2	ХТКС	1	0	2	0
Всього годин	40	Всього годин			40	0

Ухвалено на засіданні Вченої ради ХТФ ПРОТОКОЛ № 5 від 2024-06-03

Завідувач кафедри ХТКС _____ Вікторія ТОБІЛКО
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Ольга ЛІНЮЧЕВА
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;